

ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСИТОННЫХ СПЕКТРОВ В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНКАХ GaN

© Д.К. Нельсон, Ю.В. Мельник, А.В. Селькин, М.А. Якобсон,
В.А. Дмитриев, К.Ж. Ирвин*, К.Х. Картер мл.*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
194021 Санкт-Петербург, Россия

*Cree Research, Inc., Durham, USA

(Поступила в Редакцию 24 июля 1995 г.)

Измерены низкотемпературные экситонные спектры люминесценции, отражения и поглощения света эпитаксиальных пленок GaN/6H-SiC. Из анализа спектров впервые определены силы осцилляторов и значения диссипативного затухания экситонных резонансов. Исследование температурной зависимости люминесценции GaN позволило выделить вклады в излучение свободных и связанных экситонов.

В последние годы достигнут заметный прогресс в технологии выращивания нитридов элементов третьей группы. Это связано с тем, что нитриды A_3B_5 являются перспективными материалами для создания полупроводниковых приборов, работающих в голубой и ультрафиолетовой областях спектра. Вместе с тем исследования оптических свойств этих материалов крайне малочисленны, в частности отсутствует достаточно надежная интерпретация оптических спектров, регистрируемых в области края фундаментального поглощения.

В данной работе исследовались тонкие ($1\text{--}3 \mu\text{m}$) монокристаллические пленки GaN, полученные методом газофазной эпитаксии на 6H-SiC и Al_2O_3 -подложках. Оптическая ось C кристалла (структура вюртцита) была перпендикулярна плоской поверхности пленки. Концентрация электрически активных примесей не превышала 10^{18} см^{-3} .

Образцы помещались в гелиевый криостат, позволяющий варьировать температуру от 4.2 до 70 K. Спектры отражения регистрировались при угле падения $\varphi = 45^\circ$ в поляризации света $E \perp C$ (s -компоненты) на спектрометре МДР-23 с использованием лампы нагревания КГМ-100. Для исследования спектров поглощения использовались пленки GaN, выращенные на подложках из Al_2O_3 . Спектры люминесценции и отражения изучались на пленках GaN, выращенных на 6H-SiC-подложках. Для возбуждения спектров люминесценции использовалась ртутная лампа.

На рис. 1 представлены спектры отражения пленки GaN, измеренные при температуре 6 K. Известно [1,2], что валентная зона в гексагональных кристаллах GaN расщеплена кристаллическим полем и спин-орбитальным взаимодействием на три подзоны (состояния G_9 ,

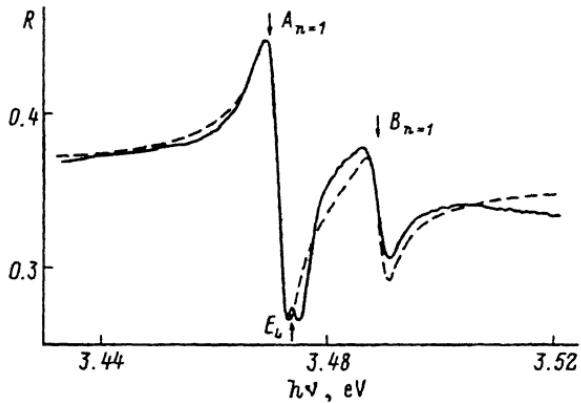


Рис. 1. Спектр отражения эпитаксиальной пленки GaN. $T = 6$ К.
Штриховая кривая — результат теоретического расчета.

Γ_7 и Γ_7 группы симметрии C_{6v}). Наблюдаемые в спектре особенности, показанные на рис. 1 стрелками, мы отождествляем с переходами в экситонные состояния $A_{n=1}$ ($\Gamma_9 - \Gamma_7$, $E_A = 3.470$ еВ) и $B_{n=1}$ ($\Gamma_7 - \Gamma_7$, $E_B = 3.489$ еВ). В области минимума отражения проявляется небольшая спектральная особенность в виде пичка (spike) при энергии $E_L = 3.474$ еВ.

Для анализа спектров отражения использовалось следующее выражение для дисперсионной зависимости диэлектрической проницаемости $\epsilon(\omega)$ с учетом безэкситонного «мертвого» слоя [3,4] толщины d_{dl} :

$$\epsilon = \epsilon_b + \frac{4\pi\beta_A\omega_{0A}^2}{\omega_{0A}^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma_A} + \frac{4\pi\beta_B\omega_{0B}^2}{\omega_{0B}^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma_B},$$

где $\omega_{0A,B}$ — резонансные частоты экситонных состояний A и B , $\Gamma_{A,B}$ — соответствующие константы затухания, $\beta_{A,B}$ — поляризуемости, связанные с продольно-поперечными расщеплениями ω_{LT} экситонных состояний ($\omega_{LT} \approx 2\pi\beta\omega_0/\epsilon_b$, где ϵ_b — фоновая диэлектрическая постоянная). Параметры $\omega_{0A,B}$, $\beta_{A,B}$ и $\Gamma_{A,B}$ определялись подгонкой по лучшему соответствуию экспериментальных и теоретических спектров (теоретическая кривая показана на рис. 1 штриховой линией). Сила осциллятора была определена из соотношения $\beta = kf$ [5], где $k = 0.2$ (коэффициент, рассчитанный для GaN).

В работах [2,6] сообщалось о наличии максимумов отражения от A -, B - и C -зон в монокристаллах GaN, выращенных на сапфировых подложках. Некоторое смещение резонансной частоты A -экситона по сравнению с нашими данными может быть связано как с разными подложками (мы исследовали спектр отражения структур GaN/SiC), так и с разным качеством исходных материалов. Однако в любом случае положение резонансного состояния может быть сдвинуто за счет деформаций, связанных с различием параметров решеток подложки и слоя, их коэффициентов термического расширения. При этом образцы на подложках SiC более совершенны вследствие меньшей разницы постоянных решетки подложки и слоя. Экситонный B -резонанс (рис. 1) оказывается близким по частоте к спектральной особенности C , наблюдавшейся авторами работ [2,6] и связываемой с C -экситонной зоной.

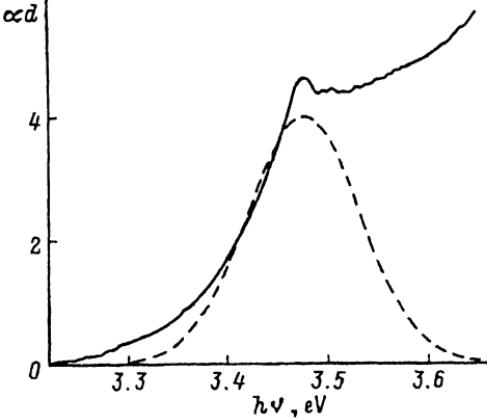


Рис. 2. Спектр поглощения пленки GaN. $T = 4.2$ К.
Толщина пленки $d = 2.3$ мкм. Штриховая кривая — результат выделения линий поглощения.

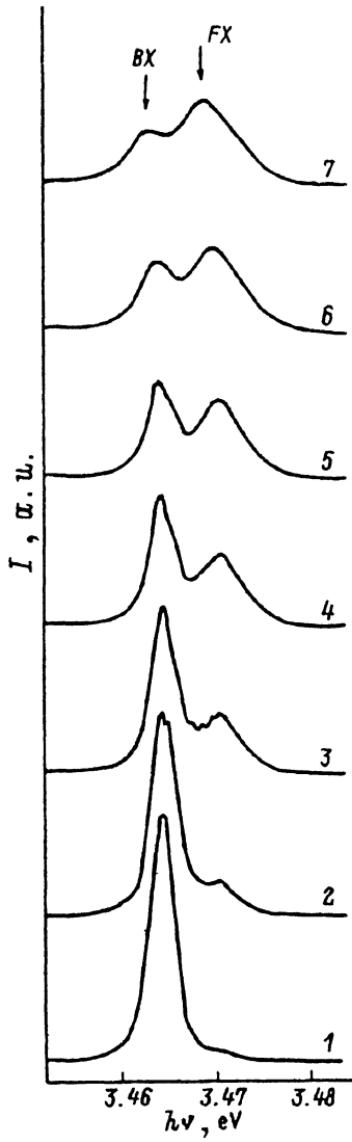


Рис. 3. Спектры люминесценции эпитаксиальной пленки GaN/6H-SiC при различных температурах.

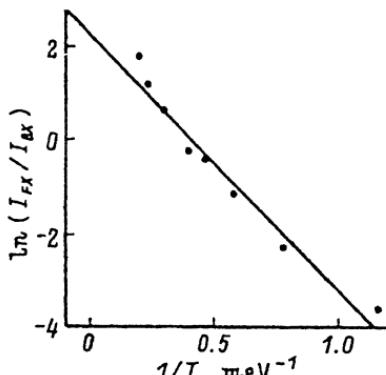
T (К): 1 — 6, 2 — 15, 3 — 20, 4 — 25, 5 — 30, 6 — 40, 7 — 60. Спектры проинтегрированы по интегральной интенсивности. Стрелками отмечены линии свободного (FX) и связанного (BX) экситонов.

Что касается пика $E_L(3.474\text{ eV})$, то его энергетическое положение коррелирует с положением особенности B из работ [2,6]. Мы не связываем наблюдаемую нами структуру E_L с проявлением B -резонанса, поскольку ее форма заметно меняется от образца к образцу. В то же время полосы отражения A и B сохраняют свой основной дисперсионный вид для всего набора исследованных образцов. Естественно интерпретировать структуру E_L , возникающую на частоте ω_L продольного экситона $A_{n=1}$, как спектральное проявление приповерхностного переходного слоя (типа «мертвого» слоя для экситона Ванье-Мотта [4]).

Относительная узкозонность подложки из SiC не позволяет исследовать оптическое поглощение в этих структурах. Такие исследования были проведены на слоях, выращенных на сапфире (спектр на рис. 2). Эти слои менее совершенны, полуширина единственного отчетливо ре-

Рис. 4. Зависимость логарифма отношения интенсивностей линий излучения свободного (FX) и связанного (BX) экситонов от обратной температуры.

Точки — экспериментальные данные, сплошная линия — линейная аппроксимация. Наклон прямой соответствует величине $\Delta E = 5.4 \text{ meV}$.



гистрируемого состояния в таких слоях составляет почти 100 meV , в то время как полуширина экситонных линий отражения в структурах на SiC не превышает $3\text{--}4 \text{ meV}$. Интегральный коэффициент поглощения K определяется из соотношения $K = \frac{\pi}{2} \alpha_{\max} \Delta = 2.7 \cdot 10^3 \text{ eV} \cdot \text{cm}^{-1}$, где Δ — полуширина линии поглощения, α_{\max} — значение коэффициента поглощения в максимуме спектрального контура поглощения. Выделение линии поглощения $A_{n=1}$ проводилось аппроксимацией края поглощения длинноволновым крылом гауссового контура [5].

Зная величину K , мы можем вычислить продольно-поперечное расщепление ω_{LT} и значение силы осциллятора f , используя известные известные соотношения [7]

$$\omega_{LT} = K \frac{ch}{\pi} \frac{1}{\omega_0 \eta}; \quad f = K \frac{\eta \Omega_0}{11010^6}.$$

Здесь Ω_0 — объем элементарной кристаллической ячейки, η — коэффициент преломления. Полученные таким образом значения хорошо совпадают с данными анализа спектров отражения.

В результате нами получены следующие параметры экситонных переходов в монокристаллических пленках GaN. Для экситона $A_{n=1}$: $\omega_{0A} = 3.470 \text{ eV}$, $\Gamma_A = 3.5 \text{ meV}$, $f_A = 0.0035$, $\omega_{LT A} = 1.8 \text{ meV}$; для экситона $B_{n=1}$: $\omega_{0B} = 3.489 \text{ eV}$, $\Gamma_B = 3.5 \text{ meV}$, $f_B = 0.0015$, $\omega_{LT B} = 0.6 \text{ meV}$, $\varepsilon_b = 9.4$, $d_{dl} = 6 \text{ нм}$.

На рис. 3 представлена температурная зависимость спектра люминесценции пленки GaN на подложке $6H\text{-SiC}$. Из этого рисунка видно, что при температуре $T \geq 20 \text{ K}$ в спектре люминесценции отчетливо проявляются две линии, коротковолновая (FX) из которых хорошо совпадает с энергетическим положением экситона $A_{n=1}$ в спектре отражения. Интенсивность каждой из линий при повышении температуры уменьшается. Длинноволновая линия (BX) быстрее гаснет с ростом температуры. На рис. 4 приведена зависимость отношения интенсивностей этих линий от обратной температуры. Видно, что эта зависимость характеризуется Больцмановским фактором $\exp(-\Delta E/kT)$ с энергией $\Delta E = 5.4 \text{ meV}$, что в пределах точности эксперимента совпадает с энергетическим расстоянием между линиями. Таким образом, температурное поведение рассматриваемых линий излучения соответствует случаю теплового равновесия. С учетом энергетического положения линии BX это позволяет предположить ее экситонно-примесную

природу. Заметим, что энергия температурного тушения, определенная по формуле Мотта [8] из температурной зависимости интенсивности линии BX , оказалась сильно заниженной, что свидетельствует о значительной роли безызлучательных процессов.

В заключение следует отметить, что в наших расчетах не учитывался вклад пространственной дисперсии (конечности трансляционной массы экситона), который, по-видимому, не очень существен для наших образцов из-за больших значений дисипативного затухания. Тем не менее учет пространственной дисперсии мог бы улучшить согласие теории с экспериментом, в частности воспроизвести спайковую структуру спектра отражения.

Авторы выражают благодарность Р.П. Сейсяну за полезные замечания и помочь при количественной обработке результатов.

Список литературы

- [1] Fiorentini Y., Methfessel M., Scheffler M. Phys. Rev. **B47**, 13353 (1993).
- [2] Dingle R., Sell D.D., Stokowski S.E., Negems M. Phys. Rev. **B4**, 4, 1211 (1971).
- [3] Hopfield J.J., Thomas D.G. Phys. Rev. **132**, 563 (1963).
- [4] Певцов А.Б., Селькин А.В. ЖЭТФ **83**, 516 (1982).
- [5] Алиев Г.Н., Кощуг О.С., Сейсян Р.П. ФТТ **36**, 2, 373 (1994).
- [6] Monemar B. Phys. Rev. **B10**, 2, 676 (1974).
- [7] Нокс Р. Теория экситонов. М. (1966). 220 с.
- [8] Шварц В. Тр. ИФА АН ЭССР **7** (1956).